

入賞 光学式ウエハ三次元形状評価検査装置「DynaSearch」 賞人

株式会社ニユークリエイション

〒182 東京都調布市富士見町4-39-9

TEL 0424(87)7711

株式会社ニユークリエイション

〒182 東京都調布市富士見町4-39-9

TEL 0424(87)7711

シリコンウエハ表面の凹凸を映像で判定する。半導体メモリーはメガビットからギガビット時代を目指し、ウエハに微細な回路を描く加工技術はますます高精度化が求められている。またウエハサイズも8インチ以上に大口径化の方向にあり、ここで問題になるのがウエハの表面精度。

新装置は極めて平行度の高い照明をウエハに当てて表面形状を陰影の濃淡として三次元で表現する。微小な突起やくぼみ、高低の度合いなどが全面にわたって数値情報で得られるため、検査員の熟練度や個人差による判定のバラツキを解消、超LSIの歩留まり向上に貢献する。また記憶媒体のディスク、液晶ディスプレイの形状検査などの需要も期待される。

